

ТЕХНОЛОГИИ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Легирование углеродных нанотрубок <i>А. Н. Сауров, С. В. Булярский</i>	3
Моделирование эмиссионных процессов углеродных нанотрубок <i>А. В. Лакалин, А. А. Павлов, А. А. Шаманаев</i>	14
Прямое преобразование энергии β -распада в электрическую <i>С. В. Булярский, А. В. Лакалин, И. Е. Абанин, В. В. Амеличев, В. Д. Рисованный, В. В. Светухин, Б. В. Иванов, И. Г. Лисина</i>	21
Исследование текстурированных пленок нитрида алюминия, полученных методом газофазного химического осаждения <i>А. Н. Редькин, М. В. Рыжова, Е. Е. Якимов, Д. В. Рощупкин</i>	30
Двухракурсная томография низкотемпературной плазмы <i>А. В. Фадеев, К. В. Руденко</i>	34

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Исследование процессов плазмохимического травления фоторезиста с помощью <i>in situ</i> оптического мониторинга <i>П. В. Волков, С. В. Зеленцов, С. А. Королёв, А. Ю. Лукьянов, А. И. Оханкин, А. Н. Тропанова</i>	44
--	----

СХЕМОТЕХНИКА

Сравнительный анализ КМОП-схем шифраторов термометрического кода в прямой двоичный код для параллельных АЦП в интегральном исполнении <i>М. М. Пилипко, Д. В. Морозов, Д. О. Буданов</i>	50
Измерение размеров элементов микросхем с ширинами меньше 100 нм методом дефокусировки зонда РЭМ <i>Ю. А. Новиков</i>	61
Разработка маршрута проектирования многопортовых регистровых файлов, включающего библиотеку элементов и компилятора на ее основе для технологии КНИ 0.25 мкм <i>П. Г. Кириченко, И. В. Тарасов</i>	72